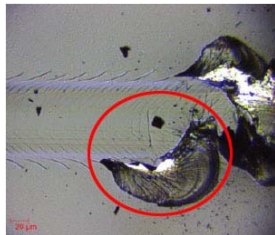


受託分析サービス

スクラッチ

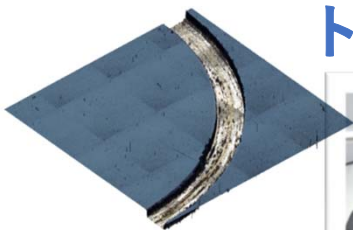


密着



	スクラッチ試験 (RST)	振動スクラッチ試験 (CSR-5100)
荷重レンジ	0.9~200N	1~1,000mN
圧子の曲率先端径	100,200μm	5,10,15,25,50,100μm
主な用途	薄膜(1μm~)の密着性評価	軟質材料の密着性評価 超薄膜(0.5μm以下)
関連規格	ISO20502 ASTM C 1624 ASTM D 7027 BS EN 1071	JIS R 3255

トライボロジー

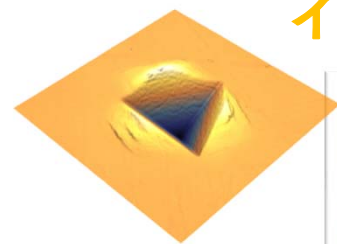


摩擦

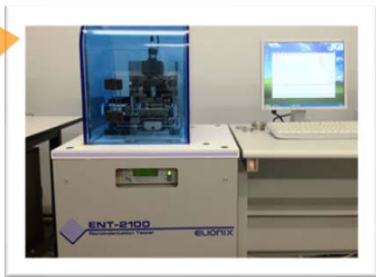


	常温摩擦摩耗 (TRB)	高温摩擦摩耗 (THT)
荷重レンジ	1~10N (摩擦力10Nまで)	
使用できるボールの大きさ	Φ6 ± 0.5mm Φ10 ± 0.5mm	
固定できるディスクの大きさ	Φ60mm以内	Φ54mm Φ30mm φ20mm
しゅう動方向	回転動 往復動	回転動
その他	JIS R 1613 温湿度コントローラー付き	850℃まで昇温可能

インデンテーション



硬さ



	硬さ試験 (ENT-2100)
測定方式	ナノインデンテーション方式
測定内容	インデンテーション硬さ・ヤング率、クリープ
圧子	ベルコピッチ圧子
推奨試料サイズ	高さ10~15mm以下、φ30mm以下
位置指定	数μm程度の位置精度があり断面サンプルの測定可能
注意事項	試料は、上面仮面が並行であることが必要です。 表面粗さが大きい場合、測定できない場合やばらつきの 要因になる場合があります。押し込み深さが、膜厚の 10% (基材や膜の硬さにより変動) 以下でない場合に基 材の硬さの影響を受ける可能性があります。

エリプソメトリー



光学定数



	分光エリプソメトリー (Auto-SE)
測定方式	液晶変調方式
光源	ハロゲンランプ及び青色LED (波長範囲: 440~1000nm)
入射角	70度固定
スポットサイズ	500μm × 500μm ~ 25μm × 60μmの7種類
サンプルステージ	X軸:Max200mm, Y軸:Max200mm, Z軸:Max40mm
その他	屈折率、消衰係数、膜厚測定可能

Auto Craterによる膜厚測定・レーザー顕微鏡による形状測定も対応しております。

Na. ナノテック株式会社

表面分析センター

TEL:04-7135-6152(表面分析センター直通) / FAX:04-7135-6126 lab@nanotec-jp.com

正規代理店: (株)ウエキコーポレーション、リックス(株)

SAC-E113 Ver.4